

UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE



米国特許商標庁における知財データの普及・活用

Nelson Yang



なぜデータが重要か？

気づき

一貫性

イノベーション

uspto

USPTOにおけるデータ

出願データ

- Patent Center

パテントファミリーデータ

- Global Dossier

バルクデータセット・サービス

Patent Center

Patent Center

EFS-WebとPAIRにかわる新統一システム

単一インターフェース

- ・特許出願の申請および管理のための単一インターフェースを特長とする

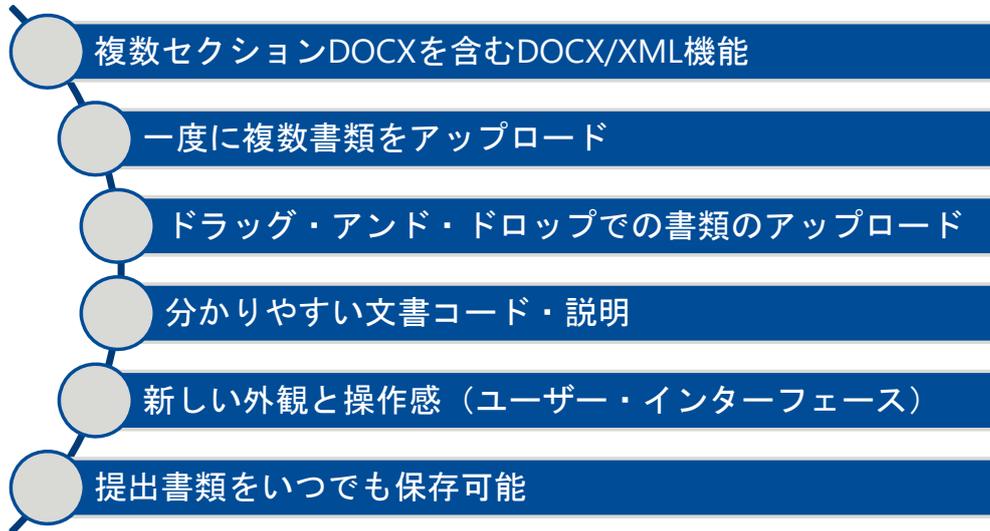
最新技術

- ・最新技術の取り入れ
- ・システム運用の改善を可能に
- ・機能拡張を可能に

認証

- ・EFS-Web およびPrivate PAIRにもアクセスできるUSPTO.govアカウントを使用
- ・ロールベースアクセスを可能に-特許実務家、実務家支援者、個人発明家、ゲストのアクセスを許可

Patent Center 概要



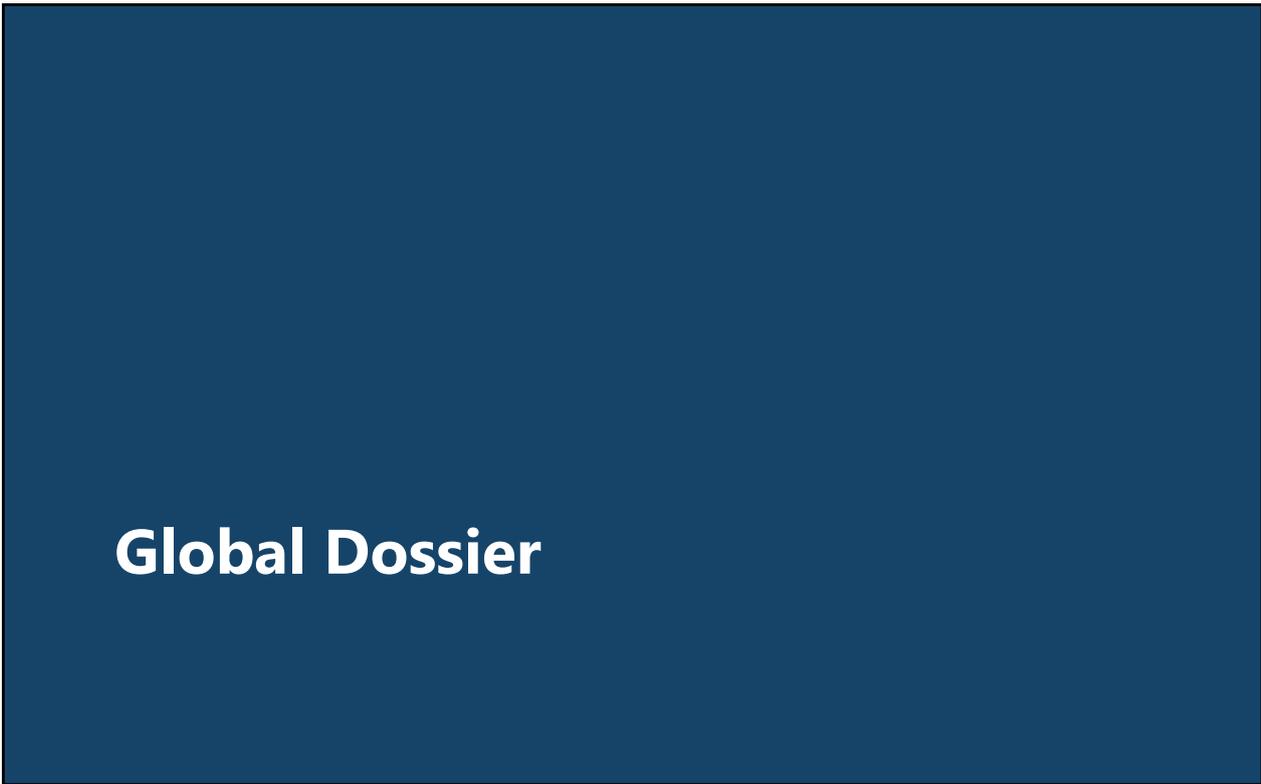
7

Patent CenterでのDOCXによる出願-利点と機能

- 安全で安定したIP文書の作成、オーサリング、処理
- ドラッグ・アンド・ドロップでの文書アップロード
- 出願のためにDOCXをPDFに変換する必要なし
- 1ファイル中の明細書、クレーム、アブストラクトを検出して分割（複数セクション）
- 文書コードの自動割り当てにより初期の処理時間を短縮
- コンテンツベースの検証を申請前に行い、審査と初期の処理時間を短縮
 - 明細書段落の番号検出
 - 独立クレームと従属クレームのカウント
 - クレーム番号の重複・欠落を検出
 - 不適切な多数従属クレームを検出
 - アブストラクトの単語数カウント
- 安全: 自動メタデータ検出とスクラブ

uspto

8



Global Dossier

グローバルなワークシェアリングの重要性

KEY IP5 STATISTICAL INDICATORS 2020

All statistics herein are preliminary. The full IPS Statistics Report 2020 will become available in the last quarter of 2021.

2.8m
patent
applications
filed at the IPS Offices in 2020

+2%
Growth in patent applications

PATENT APPLICATIONS BY BLOC OF ORIGIN

Office	Percentage	Total Applications
CNIPA	46%	1,407,159
USPTO	17%	597,475
JPO	7%	268,472
KIPO	8%	326,759
EPO	22%	800,250

PATENT GRANTS AT THE IPS OFFICES

APPROVED 1.3 million patents
granted by the IPS Offices in 2020

情報源:
www.fiveipoffices.org/statistics.html
 2021年6月29日アクセス

Global Dossierの利点

パテントファミリーデータへの統合されたアクセス

- 出願のパテントファミリーや対応する他国の知的財産庁の審査経過をリアルタイムで確認

数分で最も関連性の高い技術を表示

- 引用リストでは、パテントファミリーで引用されているすべての技術が閲覧可能で、最も頻繁に引用されている技術を最初に表示

オフィスアクション翻訳

- 中国語、韓国語、日本語のオフィスアクションのリアルタイム英語機械翻訳を提供



パテントファミリー表示

Office	Application #	Applicant	Title	App. Date	Priority #	Pub. #	Pub. Date	Action
US	13565455	1) APPLIED MATERIALS INC	Laser material removal methods and apparatus	08-21-2009	US PCT/US2009-54877 US 12092344	US 2010252781 A US 12013278 B	07-20-2010 12-11-2010	View Dossier
US	13564455	1) CHANG ZHENHUA 2) BEAKA HONGDIA YI 3) SHAN YUJIE 4) BEIBEIBAO CHEN 5) APPLIED MATERIALS INC	LASER MATERIAL REMOVAL METHODS AND APPARATUS	08-02-2010	US 13564455 US 13564488 US 13092644	US 2010205440 A1 US 8189501 B2 US 12092644	11-02-2010 10-09-2010	View Dossier
EP	10011871	1) APPLIED MATERIALS INC	LASER MATERIAL REMOVAL METHODS AND APPARATUS	08-21-2009	US PCT/US2009-54877 US 12092344	EP 2328518 A2	08-08-2011	View Dossier
LN	0712109492	1) APPLIED MATERIALS INC	LASER MATERIAL REMOVAL METHODS AND APPARATUS	08-21-2009	US 12092344	LN 70261/011 A	07-28-2014	View Dossier
JP	2011025114	1) Applied Materials Incorporated 2) SHUNDA Tomioka 3) ISOMARU Tomioka	LASER MATERIAL REMOVAL METHODS AND APPARATUS	08-21-2009	US 12092344 US PCT/US2009-54877	JP 201021040 A	01-19-2012	View Dossier
KR	2011100676	1) APPLIED MATERIALS INC	LASER MATERIAL REMOVAL METHODS AND APPARATUS	08-21-2009	US 12092344	KR 2011005724 A	08-03-2011	View Dossier
US	PCT/US2009-54877	1) APPLIED MATERIALS INC 2) CHANG ZHENHUA 3) BEAKA HONGDIA YI 4) SHAN YUJIE 5) BEIBEIBAO CHEN	LASER MATERIAL REMOVAL METHODS AND APPARATUS	08-21-2009	US 12092344	WO 201007712 A2 WO 201007712 A3	03-11-2010 05-14-2010	View Dossier
US	1264488	1) APPLIED MATERIALS INC	LASER MATERIAL REMOVAL METHODS AND APPARATUS	08-21-2009	US 1264488 US 12092344	US 2010055901 A1 US 8284261 B2	03-04-2010 09-09-2010	View Dossier

オフィスアクション表示

出願書類 表示

Global Dossier

Application Number: EP 09811971

Documents: View All

Description	Date	Count	Group
CDS Clean up - an... data concerning th... representative of t... applicant (Associat...			
Refund of fees	07/23/2014	2907	unknown
Refund of fees	07/23/2014	2907	unknown
Final instructions (application deemed to be withdrawn/application refused)	07/15/2014	1303	unknown
Application deemed to be withdrawn (non-payment of renewal fee)	04/14/2014	2524	2
Notice drawing attention to the payment of the renewal fee and additional fee	10/07/2013	2522	2
Notification on forthcoming publication of bibliographic data	05/11/2011	1219	2
Communication regarding possible amendment of the application/payment of claims fee	04/14/2011	1226C	unknown
(Electronic) Receipt	03/25/2011	RECEIPT-OLF	unknown

Annotations:

- Patent Family - other documents direct jump
- Download
- Document list download

13

引用文献リスト - 拡張表示

Global Dossier Citation List

Office: US | Type: Application | 12344567

US 12344567 SYSTEM AND METHOD OF SWITCHING FROM...

Filters: CITATIONS IN PATENT FAMILY

#	OFF.	APP. #	APP. DATE	PUB. NUMBER (DATE)	RELEVANCY DATA
1	US	PCT/US09/65917	11/25/2009	WO 2010074880 A1 (07/01/2010)	Sections: paragraph 4; paragraph 6; paragraph 57 - paragraph 58 Claims: 1-2,6-7,11-12,16-17,3-5,8-10,13-15,18-21,28,35,42 Claims: 1-2,6-7,11-12,16-17,3-5,8-10,13-15,18-21,28,35,42
2	KR	20117017637	11/25/2009	KR 20110099779 A (09/08/2011), KR 101367043 B1 (02/24/2014)	

14

追加のデータ提供ツール

特許譲渡検索

Publication	Assignor	Assignee	Patent
2016015424	ASSIGNMENT OF ASSIGNOR INTEREST SEE DOCUMENT FOR DETAILS	IBM GLOBAL TECHNOLOGY CORPORATION LLC	2016015424
2016015424	ASSIGNMENT OF ASSIGNOR INTEREST SEE DOCUMENT FOR DETAILS	IBM GLOBAL TECHNOLOGY CORPORATION LLC	2016015424
2016015424	ASSIGNMENT OF ASSIGNOR INTEREST SEE DOCUMENT FOR DETAILS	IBM GLOBAL TECHNOLOGY CORPORATION LLC	2016015424

ユーザー・インターフェース

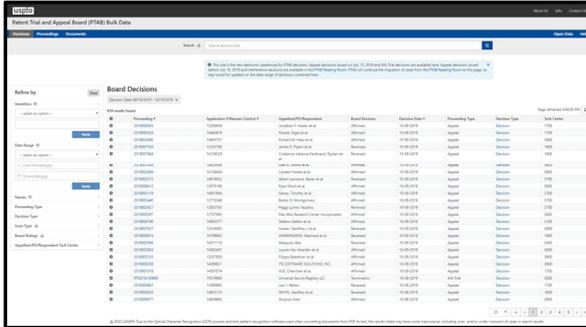
```

{
  "response": {
    "type": "string",
    "description": "string",
    "action": "string",
    "action": "string",
    "action": "string",
    "action": "string",
    "action": "string"
  }
}

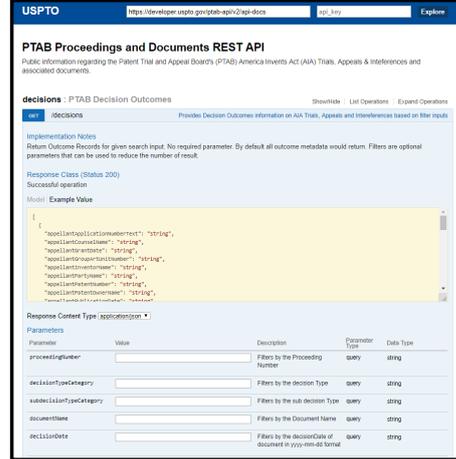
```

APIアクセス

特許審判部 (PTAB) のバルクデータ



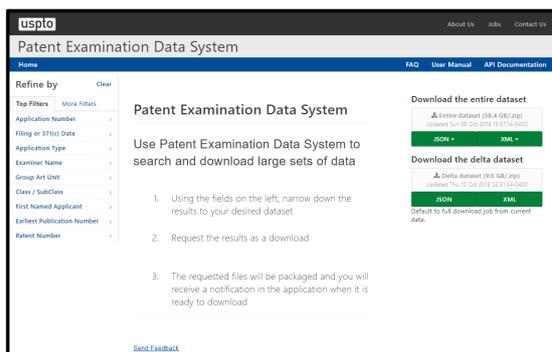
ユーザー・インターフェース



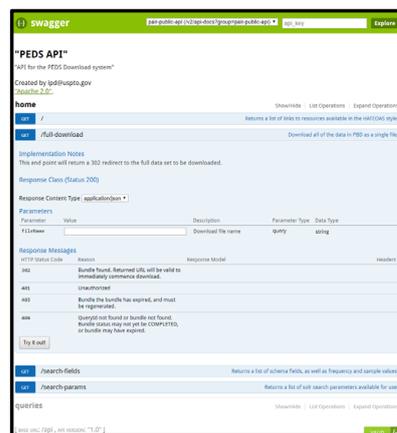
APIサービス

17

特許審査データ



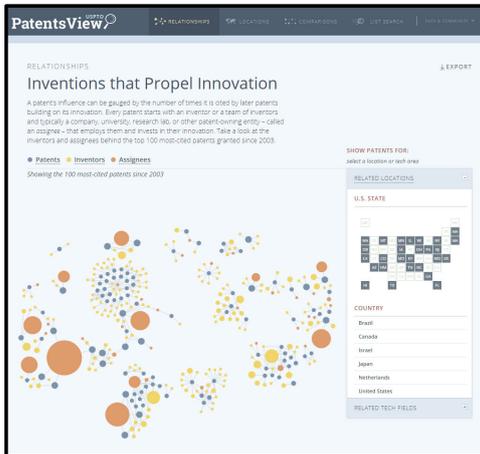
ユーザー・インターフェース



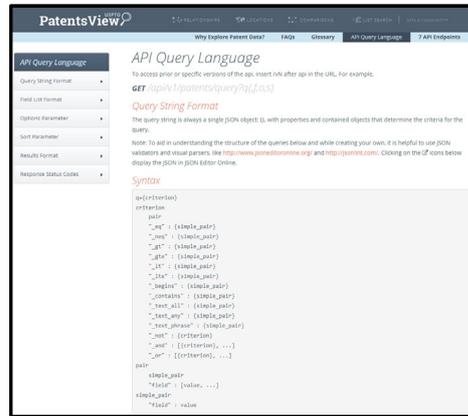
APIアクセス

18

PatentsView



ユーザー・インターフェース



APIアクセス

19

連絡先情報

Electronic Business Center

営業時間：月曜日から金曜日、午前6時から深夜12時(米国東部標準時)、連邦法定休日を除く

電話番号：

- フリーダイヤル: +1 866-217-9197
- ローカル: +1 571-272-4100

Email: ebc@uspto.gov

Global Dossier

Email: GlobalDossier@uspto.gov

特許譲渡検索

<https://assignments.uspto.gov>

PTABバルクデータ

<https://assignments.uspto.gov>

特許審査データ

<https://ped.uspto.gov/peds/>

PatentsView

www.patentsview.org



20

